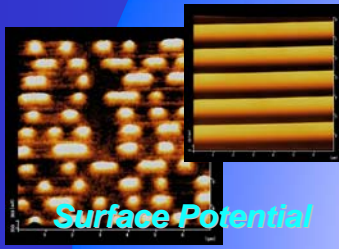
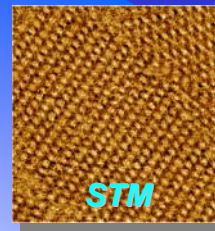
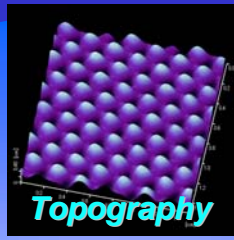
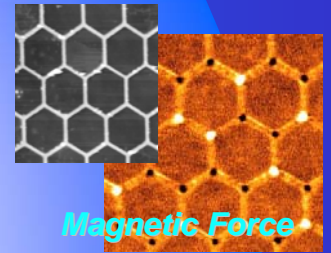


奈米尺度量測分析技術與應用研討會



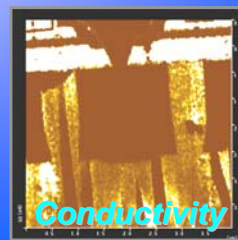
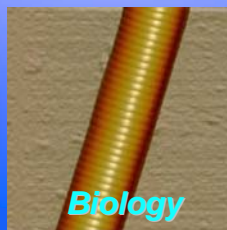
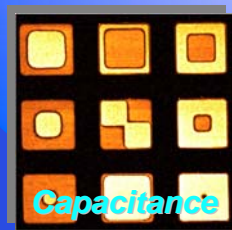
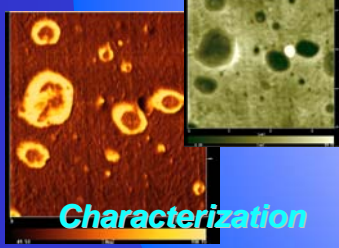
SII
SII NanoTechnology Inc.



New Generation Probe Station

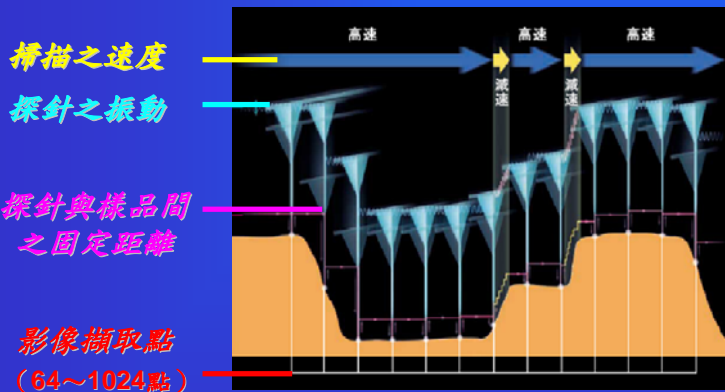


NanoNavi



SPM新技術發表

SIS (Sampling Intelligent Scan)



Cantilever approaches to a sample only when data collection is required. This scanning mode is suitable to measurement of high aspect surface, surface with high adhesion to tip, and is also excellent in cantilever wear!

演講者

- Dr. Takashima Kenichi / SIINT (電特性與磁力量測技術)
- Dr. Nishimura Toshiya / SIINT (SPM技術的最新動向)
- Dr. 林世明 / 台大醫學院光電生醫中心 (生物奈米量測與奈米診斷)
- Dr. 蔡毓楨 / 中興大學化工/材料所 (AFM Lithography用於奈米管之電化學合成)
- Dr. 曾賢德 / 清華大學物理所 (以靜電力顯微鏡量測與操控電荷)

主辦單位：富智科技股份有限公司
日本精工電子奈米科技有限公司

報名電話：(02)82273001
(02)82273456
聯絡人：施歆儀、李曉萱

活動時間與地點：95年4月21日 成功大學國際會議廳第三室
95年4月24日 台大凝態中心演講廳104室
95年4月25日 工研院奈米中心67館104室